МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"__" _____ 2023 р.

Спеціальність	176 Мікро- та наносистемна техніка	Факультет/ННІ	Факультет електроніки
Освітня програма	Мікро- та наноелектроніка	Форма здобуття вищої освіти	*Очна*
Освітній ступінь	магістра	Строк навчання	1 рік 4 місяці
Випускова кафедра	*Кафедра мікроелектроніки*	Кваліфікація	Магістр з мікро- та наносистемної техніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами							
								Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор												1 курс							
																								ДП-31мп (Б: 6, К: 2);							
																								1 семестр				2 семестр			
																								18 тижнів				18 тижнів			
																								Всього	у т.ч.			Всього	у т.ч.		
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.		Лекц	Практ	Лаб		Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	*Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав*	КМ	6	0	2.0	60	36	24	-	12	-	-	-	0	24		2	2										2	1.33	0.67	
2	*Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності*	КІВПП	6	0	1.0	30	18	12	-	6	-	-	-	0	12													1	0.67	0.33	
3	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації*	АМТС1	6	0	3	90	72	-	-	72	-	-	-	0	18		2	1					1	2		2		2		2		
4	*Менеджмент стартап проектів*	МП	6	0	3.0	90	54	18	-	36	-	-	-	0	36		1	1						3	1	2						
5	*Foundations of sustainable developmen (Основи сталого розвитку)*	ШІ	6	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		2	2										2	1	1	
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					11	330	216	72	0	144	0	0	0	0	114	0	4	4	0	0	0	0	1	5	1	4	0	7	3	4	0
Цикл професійної підготовки																															
6	*Наноматеріали та нанотехнології*	ME	6	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	1		1				1		4	2	2					
7	*Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах*	ME	6	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78		1	1			1			4	2	2					
8	*Електронні сенсори*	ME	6	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	1		1			1			4	2		2				
9	*Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем*	ME	6	0	7.0	210	108	54	-	54	-	-	-	0	102	1		1						6	3	3					
10	*Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Курсовий проєкт*	ME	6	0	1.5	45	0	-	-	-	-	-	-	0	45		1			1											
11	*Фізико-хімія поверхні*	ME	6	0	2.5	75	36	18	-	18	-	-	-	0	39		2	2										2	1	1	
12	*Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень*	ME	6	0	2.0	60	27	9	-	18	-	-	-	0	33		1							1.5	0.5	1					
13	*Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації*	ME	6	0	2.0	60	18	-	-	18	-	-	-	0	42		2											1		1	
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					30	900	405	189	0	180	0	36	0	0	495	3	5	5	0	1	2	1	0	19.5	9.5	8	2	3	1	2	0
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					41	1230	621	261	0	324	0	36	0	0	609	3	9	9	0	1	2	1	1	24.5	10.5	12	2	10	4	6	0
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																															
14	*Проєктування аналогових інтегральних схем*	ME	4	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2			2							3	2	1	
15	*Бездротові сенсорні мережі*	ME	5	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2			2							3	2	1	
16	*Системи обробки сигналів*	ME	2	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2			2							3	2	1	
17	*Моделювання технологій та приладів наноелектроніки*	ME	4	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2			2							3	2	1	
18	*Системи перетворення сигналів*	ME	2	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2			2							3	2	1	
19	*Кристалохімічні основи технології наноструктур*	ME	1	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2			2							3	2	1	
20	*Спецкурс мікро- та наносистемної техніки*	ME	2	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2				2						3	2	1	
21	*Системи обробки цифрової інформації*	ME	5	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2				2						3	2	1	
22	*Оптоелектронні інформаційні системи*	ME	5	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2				2						3	2	1	
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					23	690	270	180	0	90	0	0	0	0	420	3	2	5	0	0	3	1	1	0	0	0	0	15	10	5	0
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	270	180	0	90	0	0	0	0	420	3	2	5	0	0	3	1	1	0	0	0	0	15	10	5	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					64	1920	891	441	0	414	0	36	0	0	1029	6	11	14	0	1	5	2	2	24.5	10.5	12	2	25	14	11	0

Кількість	Кількість екзаменів	6	3			3			
	Кількість заліків	11		4			7		
	МКР	14			6			8	
	Курсових робіт	0							
	Курсових проєктів	1	1						
	РГР, РР, ГР	5		2			3		
	ДКР	2			1			1	
	Рефератів	2				1			1

Ухвалено на засіданні Вченої ради ФЕЛ ПРОТОКОЛ № 04/2023-1 від 2023-04-10

Завідувач кафедри ME _____ Дмитро ТАТАРЧУК
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Валерій ЖУЙКОВ
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;